

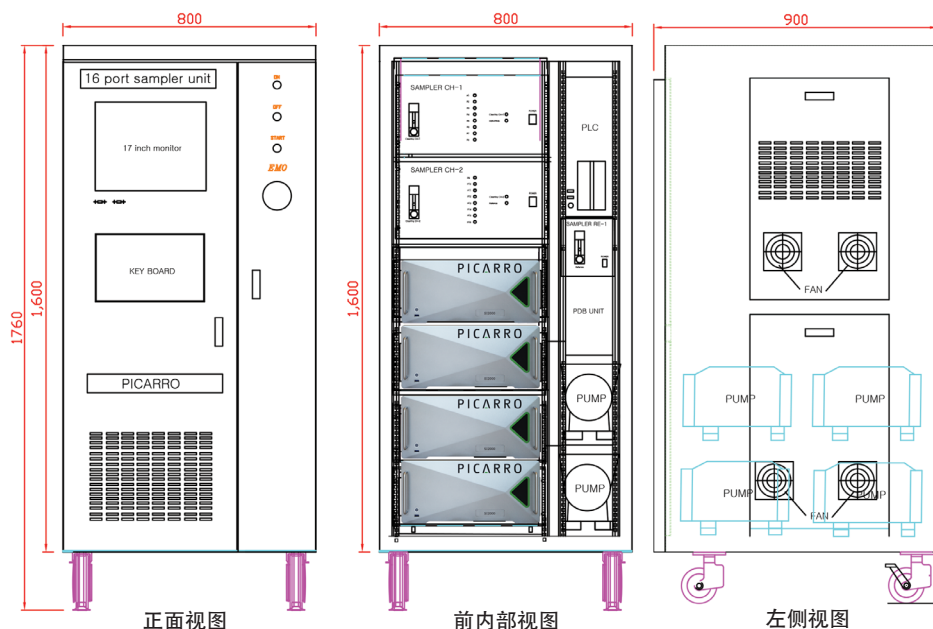
全自动连续工艺 AMC 监测系统

适用于 HF、HCl、NH₃ 和 H₂S 分析仪

PICARRO

- 专为 Picarro 分析仪定制设计的 AMC 系统
- 同步连续吹扫多路进样系统，实现多采样点位的快速扫描
- 支持用户可编程泄漏监测搜索模式
- 可配置 8、16、24 或 32 个采样端口
- 仅需数分钟即可从 ppm 级泄漏事件恢复至洁净室标准水平
- 专为 Picarro SI2000 系列分析仪优化性能

Picarro AMC 过程监测系统通过扩展分析仪覆盖的监测范围，显著提升了 Picarro 分析仪的价值。该系统专为优化反应性气体存在时的响应时间而设计，在阀门、连接器、采样管线和多路气体进样系统中实现最低残留滞留。多路气体进样系统采用质量流量控制器和大流量真空泵，可实现远距离样品采集，最高可达 200 m。坚固耐用的多路气体进样系统是不同采样点位之间快速切换的理想选择，可实现对晶圆厂及其辅助区域（如地下厂房和净化区）的广阔区域覆盖。Picarro 坚固可靠的组件与 SI2000 系列分析仪配合，确保实现 AMC 过程监测的最佳系统性能。



可连续监测多达 32 个采样点位，快速识别空气分子污染事件！

Picarro 采样系统状态屏幕



AMC 过程监测系统软件

用户可通过默认程序或自定义程序来设置多个点位的采样和泄漏监测搜索模式。默认每个点位的测量时间建议为 30 s，并进行循环测量。多路气体进样系统可设置为该速率的两到三倍，或更快的速度测量 8 路气体进样系统的每个通道。用户还可以编辑测量场景，以优化泄漏事件位置的锁定，或用于泄露规模动态监测（从低浓度 ppt 到 ppb 级浓度演变），并支持多达 32 个（或更多）潜在泄漏的点位监测。泄漏监测方案支持自动和手动两种模式。预防性维护清洁可通过编程控制周期执行。系统状态屏幕可以显示每个采样点位的组分以及分析仪的压强和温度。凭借每个多路气体进样系统的大流量连续吹扫设计，以及合理的年度采样管线维护，彻底免除长距离采样管路的频繁冲洗需求，即使是遭遇 ppm 级的高浓度气体泄漏事件，也无需过度冲洗。

A0317 采样系统规格				
型号	A0317-8	A0317-16	A0317-24	A0317-32
功耗	300 W	500 W	700 W	900 W
电源要求	100–110 V, 220–240 V, 50/60 Hz			
采样管线	3/8 英寸 PFA 管			
配置	固定机架			
外形尺寸	80 x 90 x 178 cm (31.5 x 36 x 70 英寸)			
重量	220 kg (485 磅)			
采样泵最大流量	60 升/分钟			
工作环境温度	5–40 °C			
工作环境湿度	无冷凝条件下，相对湿度 <99%			